BEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-207718

(43) Date of publication of application: 25.07.2003

(51)Int.CI.

G02B 21/24 G02B 21/06

(21)Application number : 2002-006613

(71)Applicant: JAPAN SCIENCE & TECHNOLOGY

CORP

KOMATA KIMIO

NITTA ISAMU

(22)Date of filing:

15.01.2002

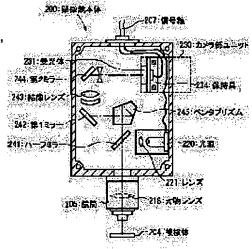
(72)Inventor: KOMATA KIMIO

NITTA ISAMU

(54) MICROSCOPE APPARATUS

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a small-sized microscope apparatus which provides clear images. SOLUTION: A spot light source 220 comprising an LED, etc., is fixed by means of a holder to a body 200. The light from the light source 220 heads through a lens 221 toward a half mirror 241. The luminous flux reflected 90° by the half mirror 241 arrives at the examinee 204 through an objective lens 218 of a body tube 205. The luminous flux reflected by the examinee 204 tracks back the same optical path and heads toward a pentagonal prism 245 through the half mirror 241. The luminous flux reflected by the prism 245 forms the image at a photoreceiving body 231, such as a CCD, through a first mirror 242, an image formation lens 243 and a second mirror 244. Since the luminous flux from the spot



light source 220 has high directictivity, the uniform illumination is eventually received evenly on the observation surface of the examinee and if there is a shape change, such as a flaw, the dark part by a shade is formed in a contour segment. As a result, the image stressed in the contour is obtained.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

16.01.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-207718

(P2003-207718A)

(43)公開日 平成15年7月25日(2003.7.25)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

G 0 2 B 21/24

21/06

G 0 2 B 21/24 21/06

•

2H052

審査請求 有 請求項の数7 OL (全 13 頁)

(21)出願番号

特顧2002-6613(P2002-6613)

(22)出願日

平成14年1月15日(2002.1.15)

(71)出願人 396020800

科学技術振興事業団

埼玉県川口市本町4丁目1番8号

(71)出願人 300089563

小俣 公夫

埼玉県浦和市太田建1丁目1番21号

(71)出顧人 501094018

新田 勇

新潟県新潟市寺地1130-9

(74)代理人 100105371

弁理士 加古 進

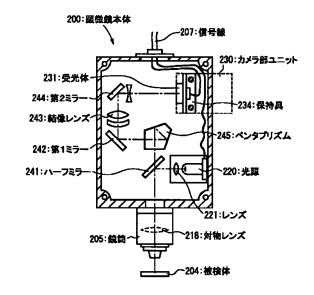
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 顕微鏡装置

(57)【要約】

【課題】明瞭な画像を得ることができる小型の顕微鏡装 置の提供

【解決手段】LED等で構成した点光源220は、保持具を介して本体200に固定されている。光源220からの光はレンズ221を経てハーフミラー241に向かう。ハーフミラー241で90度反射した光東は、鏡筒205の対物レンズ218を経て、被検体204に凌ずる。被検体204で反射した光東は、同じ光路をたどり、ハーフミラー241を通過して、ペンタプリズム245に向かう。プリズム245で反射した光東は、第1ミラー242、結像レンズ243、第2ミラー244を経て、CCD等の受光体231に結像する。点光源220からの光東は指向性が強いので、被検体観察面では一様に均一な照明を受けるようになり、傷などの形状変化がある場合には、輪郭部分に影による暗部が形成される。これにより輪郭が強められた画像が得られる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 LEDによる点光源と、

前記点光源からの光束を、ハーフミラーで反射し、対物 レンズを介して被観察物に向かわせ、被観察物からの反 射光束を前記ハーフミラー通過後、結像レンズで結像す るように形成した光学系とを備え、前記点光源と前記光 学系とを一体として収容することを特徴とした顕微鏡装 置。

【請求項2】 前記光学系中に、前記結像レンズで結像 した像を画像信号に変換する受光体を有することを特徴 とする請求項1記載の顕微鏡装置。

【請求項3】 前記点光源は、実質的に光軸方向に移動できることを特徴とする請求項1又は2に記載の顕微鏡装置。

【請求項4】 前記点光源は、発光色の異なる複数のL EDを有し、

該複数のLEDを、選択的に前記光学系の点光源として 使用できることを特徴とする請求項1~3のいずれかに 記載の顕微鏡装置。

【請求項5】 前記点光源又は前記光学系は、前記点光源の光路方向を変化させることが可能であるように構成されていることを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の顕微鏡装置。

【請求項6】 前記点光源は、選択可能である、異なる 光路方向の複数のLEDで構成されていることを特徴と する請求項5に記載の顕微鏡装置。

【請求項7】 前記点光源は、選択可能である複数のLEDとレンズ又はプリズムで構成されていることを特徴とする請求項5に記載の顕微鏡装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、顕微鏡装置に関するものであり、特に、反射型の照明系を有する顕微鏡装 置に関するものである。

[0002]

【技術的背景】従来より、顕微鏡は各種のものが良く知られている。例えば精密光学顕微鏡や電子顕微鏡は、観察結果が高倍率で高精度に安定して得られるように工夫されている。また、これらの顕微鏡には、例えば微分干渉法などによるエッジ強張機能が付加されているものある。しかし、この様な高倍率で高精度の顕微鏡に対する操作は高度の熟練を要し、使用できる者は、特別に訓練された専門の技術者や科学者だけに限定されてしまうことが多い。それだけでなく、これらの高倍率・高精度の顕微鏡の価格は、非常に高価となっている。一方、通常の比較的安価な光学顕微鏡は、一般の人だけでなく。この安価な光学顕微鏡は、例えば、図1に示すように、被検体を倍率を変えて観察するために、上下動する鏡筒110に接続している複数の対物レンズ112

と、鏡筒110内の接眼レンズ114と、被検体に外部からの光を取り込み照明するための反射ミラー120と、被検体を載置する観察台130などで構成されている。即ち、この様な顕微鏡では、光学系は経済的にという制約で透過式が採用されている。そのため被検体は光が透過できるように薄片に加工しなければならない。照明系も外部からの光を反射ミラーで取り込んでいるために、微妙な調整をその都度行なわなければならない。

【0003】このように、通常の顕微鏡では安価ではあ

るが被検体を観察できる状態にするまでの前工程作業が 必要であり、これが大変煩わしく熟練も要し、学校教育 の場ではこれを先生が担当し、それから生徒に観察させ るという工程をとっている。又、前述したように、顕微 鏡100自身は、対物レンズ112と接眼レンズ114 を設置している鏡筒110、観察台130、反射ミラー 120というような単純な構成とはなっているが、鏡筒 110を保護して光学系全体の精度を維持するための保 護手段が不可欠となっている。ところがこの保護手段は 携帯時には不要な異形構造となって邪魔になり、特別の 収容ケースを準備し、その中に顕微鏡全体を収容するな どの対策が必要とされていた。従ってこれまでの通常の 光学顕微鏡は小学校低学年の生徒だけでなく、一般人も 含めてどのような被検体でも、どのような場所、照明の 中でも容易に扱えるというような環境が完備されている とは言えなかった。また被検体は一旦薄片とするため、 生きたままでの植物や生物の観察はしにくいという不便 さもあり、学校教育の場ではその改善が待たれていた。 【0004】これらの不便を生じる原因は、主に透過式 光学系と後に述べる照明の問題、それに携帯時の不便さ であるとされている。これを解決する1つの方法は、顕 微鏡の光学系を透過式から反射式とすれば或る程度解決 することができる。顕微鏡における反射式の照明系およ び光学系の構成例を図2(a)で説明する。この照明系 (ケーラー照明法) では、ハロゲンランプ152の像 を、コレクターレンズ154により落射照明装置の開口 絞り156の面に結像させ、リレーレンズ158、ハー フミラー170、フィールドレンズ162により、更に 対物レンズ166の後側焦点面168近くに結像させ て、対物レンズ166を通って物体164を照明する。 物体164から反射した光束は、対物レンズ166を通 過して、再び対物レンズ後側焦点面168にランプ像と して結像する。更に、アイポイントに目を置けば、接眼 レンズ174を通過することによって、目の虹彩絞りに ランプ像が結像し、目にはまったくランプ像としては現 れない。一方、視野紋り160はフィールドレンズ16 2、対物レンズ166により物体164の面に結像し、 照明視野を制限する。この視野絞り像は、再び対物レン ズ166を通過し、対物レンズ166による像画172 に結像する。更に、接眼レンズ174と目により目の網 膜に再結像し、視野絞り像として現れる。この様な構成 にすると、物体に必要最小限の光東を均一に照射することができる。かつ、開口絞りは明るさと焦点深度を、視 野絞りは視野をそれぞれ独立にコントロールすることが 可能となる。

【0005】この様に照明系を反射式とすれば、外部か ら光を採る照明用反射ミラーの操作や薄片を作り出す作 業を省くことができる。また、それに伴い反射ミラーに よる明るさの維持や被検体薄片の加工精度の修練という 煩わしい作業も除去することができる。さらに顕微鏡自 体の形状も工夫できるから、携帯時もさほどの注意を必 要としないで済む。しかし、このような反射式の照明系 とするためには、大がかりな光学系と新たに照明用光源 の設置が求められる。この光源の問題について述べる。 各種の照明用光源としてハロゲンランプが採用される場 合が多い。これは所定の照度が容易に得られるためであ るが、しかし一方ではエネルギーが熱に変化してしま い、ファンなどの冷却装置が必要となってくる。そして それに伴いファンによる振動が発生したり、光源装置全 体が大型になってしまうという欠点も生じてくる。また ハロゲンランプ自身が持つ欠点として制御の応答性が悪 いということが上げられる。これは電圧をかけてもすぐ に輝度が上がらないということで、その輝度も時間によ って微妙に変化するという現象を有している。これらの ことは顕微鏡の光源としてハロゲンランプを使用し、し かもその顕微鏡を工業用として各種作業現場で実際に使 用するような場合、観察結果に誤差を生み出す因となり やすい。例えば金属加工部門での表面仕上がり状況や 傷、ごみなど付着物の確認、電子機器に使用される各種 基盤の導通確認や線幅の確認、或いはカラー印刷物の網 点形状の確認などの作業に使用した場合、その結果が大 きな問題となる。

【0006】図2(b)はこの観察状況を説明するもの で、被検体表面の明るさを表している。図において縦軸 は明るさを、横軸は被検体観察面の寸法を示している。 もし観察面に傷やごみなどが付着していると、ハロゲン ランプなどの照明を受けたときその立体部分は照度が強 調されて表現される。図の例では2つの傷があり、P1 とP2のピークとして明るさが示されている。ところが 光源の明るさにムラが生じ、あるレベルまでしか達しな いと区域L2以上にあるピークP2しか確認できない が、明るさが変化して区域し1以上のレベルとなると、 2つのピークP1、P2を確認することができる。つま り光源の明るさによって傷の数が1つであったり2つに なったり変化し、観察結果に誤差が生じることになる。 これは傷だけでなく、ゴミの数や計測する線幅寸法など にも影響を与えるということになる。このような問題を 避けるために、光源に安定化回路を付加したり、照度を 光源にフィードバックするようなことも考えられるが、 その分コストが上昇することになる。また振動の発生は レンズ倍率が高くなればなるほど、除去しなければなら

ない問題として指摘される。従って光学系にハロゲンラ ンプなどの光源を付加して反射式光学系としての機能を 発揮させたとしても、顕微鏡装置自身が振動、大型化、 コスト高、輝度の変化などを発生し、解決しなければな らない問題として残される。その結果、観察結果の品質 にバラツキが生じることになる。例えば、ある作業現場 で担当者が得た結果を、現場から離れた会議室の様な所 で操作したときに、同じ被検体と同じ顕微鏡を用いて も、同じ結果が得られるとは限らないということにな る。このことは誰でもが、どのような被検体であって も、どのような場所でも観察面を高倍率にして確認でき るという顕微鏡本来の目的から逸脱してしまうことにな る。さらに在来の顕微鏡には表示手段や紙上にプリント アウトするという機能や、或いはデータとして保存する という機能が付加されていない場合が多いが、たとえ付 加されていたとしても、大がかりなシステムとなってし まい、色々な場所へ持っていくことができず、1つの顕 微鏡で同時に複数の人がその観察結果を見ることができ ない。そのため観察結果に基づいて論議したり、後日に 観察結果を再確認するという様な時に時間がかかる問題 が発生する。これらのことは想像力や好奇心の髙揚を阻 害する一因となりかねず、その改良が待たれていた。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記問題を解決した、反射型の照明系を備えた顕微鏡装置を提供することを目的とする。それも光学系の精度維持と堅牢性、携帯性が考慮され、人や場所が変化しても観察結果が左右されない安定性を備え、さらに安価な構造でありながら高品質の観察像が得られるようにした顕微鏡を提供することである。

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため に、本発明は、LEDによる点光源と、前記点光源から の光束を、ハーフミラーで反射し、対物レンズを介して 被観察物に向かわせ、被観察物からの反射光束を前記ハ ーフミラー通過後、結像レンズで結像するように形成し た光学系とを備え、前記点光源と前記光学系とを一体と して収容することを特徴とした顕微鏡装置である。前記 光学系中に、前記結像レンズで結像した像を画像信号に 変換する受光体を有することもできる。また、前記点光 源は、実質的に光軸方向に移動できるように構成しても よい。前記点光源は、発光色の異なる複数のLEDを有 し、該複数のLEDを、選択的に前記光学系の点光源と して使用できる構成としてもよい。前記点光源又は前記 光学系は、前記点光源の光路方向を変化させることが可 能であるように構成してもよい。この場合、前記点光源 は、選択可能である、異なる光路方向の複数LEDや、 選択可能であるLEDとレンズ又はプリズムで構成して もよい。

[0008]

【発明の実施の形態】図面を参照して、本発明の実施形

態を説明する。図3は、本発明の顕微鏡装置の実施形態 の一例を示す構成概略図である。図3において、顕微鏡 本体200には、内部に光学系が収容されている。顕微 鏡本体200は、台座203に固定した支柱209上 で、ねじ211、212などで連結した微調装置202 により、上下、左右方向に移動したり、回転することが できる。顕微鏡本体200に着脱自在に取り付けた鏡筒 205の内部には、任意倍率の対物レンズを有してお り、これにより、被検体204を観察することができ る。顕微鏡本体200でCCD等により撮影した画像信 号は、信号線207を介して制御部192,表示部19 4を備えた制御表示装置190に送られる。この制御表 示装置190は、顕微鏡本体200の内部の光源に電力 を供給することができる。顕微鏡本体200内のCCD 等からの画像信号は、表示部194により観察する。ま た、観察した画像は、制御表示装置190内に設けられ たハードディスク等に記憶しておくこともできる。微調 装置202には金具213が取り付けられ、ねじ211 を回転することによって、顕微鏡本体200は、台座2 03に固定した支柱209に沿って下方向に微少量移動 できる。図3では図示されていないが、この金具213 と同様な金具がもう1つ別に微調装置202に取り付け られていて、そのねじ212を回転することによって、 顕微鏡本体200を左右方向に微少量移動できるよう構 成されている。金具213とねじ211,212の構造 や顕微鏡本体200を移動させる実際の構造は任意のも のを採用でき、ここでは市販されている直線2ステージ と、Xステージを採用している。同様に、回転ステージ を顕微鏡本体200に取り付けておけば、回転方向にも 動作させることができる。従って顕微鏡本体200を支 柱209に沿って移動させる場合、大きな移動は手操作 で、微少な移動はねじ211,212を用いて実施する ことができる。顕微鏡本体200と微調装置202を台 座に対して保持する実際的な構造(この例では支柱20 9) や、支柱209と微調装置202間の制動と、その 位置固定用の手段については既存のものを採用できるの で、ここではその具体的な説明を省略する。また制御表 示装置190はパーソナル・コンピュータ・システムに よって構成できる。顕微鏡本体200内の光源に電力を 供給する電源ユニットは、制御部192とは別に独立し て設置できるようにしておけば、バッテリの使用も可能 となる。また、本体200の姿勢制御を手動で行う構成 例を示しているが、アクチュエータを設置して、制御表 示装置190によりアクチュエータを制御する構成とす ることもできる。大きな移動は、台座203に大きな移 動のための機構を取り付けて、顕微鏡本体200を前後 左右の方向に大きく動かすことができる。

【0009】図4は、顕微鏡本体200の内部を一部断面図として示した正面略図で、筺体状の本体200から蓋214(図3)を外して、内部を見える状態としたと

きを示している。図4において、LED等で構成した光 源220は、保持具を介して本体200に固定されてい る。光源220からの光は、照明用レンズ221を経て ハーフミラー241に向かう。ハーフミラー241で9 0度反射した光束は、鏡筒205内に固定した任意倍率 の対物レンズ218を経て、被検体204に達する。被 検体204で反射した光束は、同じ光路をたどり、ハー フミラー241を通過して、ペンタプリズム245に向 かう。プリズム245内で偶数回反射した光束は、第1 ミラー242, 結像レンズ243, 第2ミラー244を 経て、CCD等の受光体231に結像する。受光体23 1に結像し光電変換された画像信号は、信号線207よ り図2の制御表示装置190に向かう。受光体231は 本体200に保持具234によって固定されている。前 述の光学系を形成する各部材、光源220、照明用レン ズ221、ハーフミラー241、ペンタプリズム24 5、第1ミラー242、結像レンズ243、第2ミラー 244のそれぞれも、図示してない保持具によって顕微 鏡本体200に固定されている。鏡筒205は、本体2 00に対してねじ止めなどにより着脱自在に取り付けら れている。この鏡筒205を交換することによって、内 部に取り付けた対物レンズ218の倍率を変換するよう にしてある。そのため携帯時には、鏡筒205を本体2 00より取り外すことができる。取り外したとき、その ねじ穴にキャップなどを装着するようにすれば、本体2 00内部にほこり等の進入を防ぐことができる。光源2 20は保持具ごと本体より取り外して交換できるように しておけば、目的に応じた波長の光源を光学系中に設置 することができる。

【0010】図2、3に示した構成例では、顕微鏡本体 200を方形の筐体として構成し、その内部にLEDで 構成した光源を含めた光学系を収容している。この光学 系では、被検体204の観察面を対物レンズ218で任 意倍率に拡大し、その像を画像信号として制御表示装置 190の表示部194に伝え、表示するようにしてい る。それによって光学系全体は、筐体とした本体200 内に収容され、精度維持を図りながら、保護と小型化を 進めることができ、携帯性にも対処することができる。 なお、図4に点線で示した枠状の230は、カメラユニ ットを示しており、本体200より受光体231,保持 具234を除去し、そこヘビデオカメラなどのユニット を設置できるようにした。このユニットは例えば市販さ れているビデオカメラであり、これを本体200に取り 付け、受光体231の位置にビデオカメラの受光体(C CD) がセットされるよう連結する。この連結機構は本 体200とビデオカメラの位置が規定されれば特別な手 段は必要としないが、このようにすることによって、制 御表示装置190の代わりとしてカメラを使用すること ができる。上述の構成では、CCD等により画像信号を 得て、それを表示する構成としたが、通常の光学顕微鏡 と同様に、直接肉眼で見る構成としてもよい。

【0011】図4に示した光学系では、光源220とし てLEDを用いているので、輝度ムラが少ない点光源と して発光する。例えば、光学系中に設置されている光源 が赤色LEDとすれば、その発光部面積は約0.24平 方mmである。これに対し、従来のハロゲンランプでは その発光部面積は約1~2平方mmである。このよう に、LEDを光源として使用すると、ハロゲンランプと 比較すると1/10程度となり、点光源とみなすことが できる。一方、ハロゲンランプは、そのおおきさから面 光源とみなすことができる。点光源からの光束は指向性・ が強いので、被検体観察面では一様に均一な照明を受け るようになり、その照明域内に傷などの形状変化がある 場合には、傷の輪郭が強調されたように発光する。つま り観察面に微少な凹凸や傷などの形状変化部がある場 合、その境界部が強められて照明を受けたかのように作 用する。

【0012】図5は、被検体204の照明状況を説明す るものである。被検体204の観察面には微少な寸法d 2分の凹凸があることを示している。このような被検体 204を図4に示す光学系で見ると、対物レンズ218 が d 。分の深度を持っているときは、被検体の凸部 2 5 6も凹部も1つの画像として同時に確認することができ る。図5 (a) に示すように、点光源からの光束によ り、被検体が照明される。すると被検体204の凸部2 56の輪郭は、その影を作って凹部上に投影する。この 影の発生は、光源を点光源として指向性を持たせたこと によるものである。なお、従来のように面光源であれ ば、図5(b)に示すように、被検体204の凸部25 4の輪郭では、色々な方向の光で照明されることとな り、光の拡散、散乱などが発生し、凸部254の影が生 成されないだけでなく、得られる画像自身の輪郭形状の 確認に支障をきたすようになる。図5の被検体204 を、例えばレーザ露光で印刷用網点を撮影した銀塩フィ ルムに形成したものとすると、被検体全体の厚さは約 0. 1 mmほどで、その表面に画線として再現される黒 化部は凸部257として形成され、その厚さ d 。は1μ mほどである。そして、この凸部から得られる影は微少 なものではあるが、これが画線部(凸部256)輪郭に 付加されて一緒に観察されるようになるから、画線部像 は一層明瞭に鮮明に再現されることになる。なお、上記 のレーザ露光用の銀塩フィルムとは、主に写真製版用に 使われるモノクロ(白黒)の写真フィルムで、白か黒か しか表現しないものである。また、光源に半導体光源の 1つであるレーザを使用した場合、その発光部の面積は 約0.003平方mmであるので、LED光源以上の点 光源となる。従って指向性をさらに強められるからLE D以上の効果を得ることができる。 しかし、単波長によ る干渉発生対策や、カラー化するための対策が必要とな る。

【0013】点光源による被検物の凹凸等に対する影 は、光源の位置、対物レンズの倍率や深度と被検物との 関係で変化する。それを利用することにより、影を強調 して、よりコントラストがあるような状態の像を得るこ とができる。それを図6および図7により説明する。図 6は、光源220の光学系中における設定位置を、変化 分dに応じて移動させたときの状態を説明するものであ る。図6(a)は、光源の像が被検物上にある状態を示 しており、図6(b)は、距離dだけ光源を移動させ て、光源の像が被検物の後ろにある状態を示している。 図6では、ハーフミラー241等は図示していない。図 7は、被検物204の凸部の影ができる様子を示してい る。図7(a)は、図6(a)のように、光源の像22 5が被検物204上にあるときの状態を拡大したもので あり、図7(b)は、点光源220を距離d移動したと きの状態を拡大したものである。さて、図7において、 被検物を照射する光線は、対物レンズ218と光源の像 225とを直線で結んだ間に存在している。また、図7 では、説明のため被検物204の凸部片側のみ表示して いる。図7(a)では、図示されているように光源の像 225から照射されるのと等価と考えられるので、被検 物204の凸部に対して均一に光が当たり、影ができに くい。図7(b)では、光束が分散され、その分凸部の 影ができやすくなっている。即ち、例えば図7(b)の 1, 3から上の対物レンズ上側の光束は、凸部により遮 られるので、影ができやすくなっている。図7に示すよ うに、光源位置の移動により凹凸の対する影が得られる ので、凹凸があるとき、その凸部輪郭や、溝、傷のよう に形状が変化したところに陰影をつけ、それを強調する ように作用し、観察画像をより鮮明に表現するようにな る。これによって、例えば微分干渉法などによる高度な 構成を付加したかのような高画質像にすることができ る。この変化分 d の実際の値は、図 4 に示した本体 2 0 0内の光学系の光路長にもよるが、0.1mm~10数 mm程度移動できるようにすれば充分である。移動のた めの機構として、例えばねじ等を使用することができ る。なお、対物レンズは、一般的にその倍率が低いと焦 点深度は深く、倍率が高いと深度は浅くなるから、凹凸 分の深度に耐えられない倍率の対物レンズを使用すると きは、図6(b)に示すように、絞り222を設置し て、その開口部を調整する。このように、LEDによる 点光源を光軸方向に移動自在とし、被検体への照明位置 を変更できるようにしておくことは、鮮明画像を得る上 で有効に作用する。また、LEDのような輝度ムラの少 ない点光源を用いることで、図6に示したような簡単な 照明系とすることができる。なお、点光源を移動するの と実質的に同じ効果が、図6において点光源220の前 に設置してある照明用レンズ221を移動することによ り得ることができる。また、影を強調したくない場合 は、光源220と照明用221の間に拡散板などを入れ ることにより、拡散光源とすることができる。

【0014】図8は、図4に示した点光源220の他の 構成例を示したものある。図8で示すように、本体20 0に軸274で支持されたターレット状基板272上 に、4つの光源 (LED) 220a、220b、220 c、220dが取り付けてある。この4つの光源はそれ ぞれ発光色が異なり、例えば白色LED220a、赤色 LED220b、青色LED220c、緑色LEDdと する。これらを基板272の軸274を中心として回転 することで、各光源220を光学系の所定光源位置にセ ットできるようにしてある。例えば、基板272の回転 は、基板272の外周部一端を顕微鏡本体200の蓋2 14から突出させ、それを指先で回転させて、図示して ない光源の位置規定機構を働かせる構成とすることがで きる。勿論光源220の色(波長)や数、その選択手段 は任意に選べるが、白色光源220aを使用すれば、受 光体231は、被検体からの反射光束をカラー信号とし て扱うことができる。赤色LED220b、青色LED 220 c、緑色LED220 dの光源を適宜使用すれ ば、例えばカラー印刷の3色の網点を観察するようなと きに便利である。また光源に赤外線用LEDを取り付け れば、コンクリート壁面内部のひび割れ、亀裂などの確 認時に利用することができる。

【0015】図9は、凹凸の輪郭部分の影を得てさらに 輪郭を強調するために、斜光を生じるための他の構成例 を示している。図9 (a) は、図4に示されている光学 系を簡略して示したものであり、付してある参照番号は 図4の光学系と同じである。図9 (a) に示した光学系 は、CCD等の受光体231, 結像レンズ243, ハー フミラー241, 点光源220, 照明用レンズ221, 対物レンズ218,被検物204で構成されている。さ て、図9(b)は、照射方向が変化する点光源290と して、照射方向がわずかに異なる、複数のLED29 1,292,293,294,295を配置している。 照射する方向により、点灯するLEDを切り替えること により、所望の照射方向をえることができる。また、影 のつけ方の変化を見るために、周囲に配置されているL ED291, 292, 293, 294を順次点灯を繰り 返すようにすることもできる。このように点灯すること により、影のできる方向が変化して、被検物204の様 子がよく分かる。また、中心のLED295と、周囲に あるLEDとにおける光量を調整できるようにして、同 時に点灯することにより、影の濃さを変えられるように することもできる。さらに、周囲に配置されているLE Dを順次点灯するタイミングに合わせて画像を取り込 み、取り込んだ画像を処理することにより、微細な像を 生成することができる。なお、中心のLEDのみを点灯 したときは、通常の点光源を1つとした場合と同様の照 明となる。また、全てのLEDを点灯することで、さら に明るい照明系とすることができる。点光源として採用 したLEDは小型なので、光学系を大きくすることなく、図9(b)に示すように、多数の点光源の集合体を形成することができる。図9(c)は、LEDによる点光源220'を動かして、被検物204への照射方向が変えられるように構成している。これにより、1つのLEDで被検物204に対して斜め方向に照明でき、影のつけ方を変えることができる。図9(d)は、ハーフミラー241'の角度を変化させ、被検物への照射方向が変えられるように構成している。

【0016】図10は、図9(b)に示したような複数のLEDによる光源290を設けた場合、異なる照射方向を得るための構成を示したものである。図10(a)は、ミラー296を用いて、図9(b)に示した複数のLEDによる光源290の配置位置や方向を変化させることができることを示している。また、図10(a)(2)および(3)は、LEDを5個や7個設けることができることを示している。図10(b)および(c)は、平行においた複数のLEDによる光源290'に、レンズ297やプリズム298を組み合わせることにより、被検物に対して異なる照射方向を得る構成を示して

向を得る構成を示している。図10(d)(1), (2)は、それぞれ側面、正面からみた図である。

いる。また、図10(d)は、複数のLEDとミラー2

99との組み合わせより、被検物に対して異なる照射方

【0017】図11は、上述の図3、図4に示した実施 形態の構成において、2種類の被検体を観察したときに 得られる像を撮影したものである。図11(a)は、銀 塩フィルムにレーザで描いたものであって、0.5mm ×0. 375mmの領域を、倍率を10倍とした対物レ ンズで拡大したものである。この画像は、点光源の位置 を調節して、影によるコントラストを強調したものであ る。また、図11(b)は、倍率を50倍とした対物レ ンズで、塩の結晶を撮影したものである。このように、 本発明の顕微鏡装置を使用することにより、はっきりと した画像を簡単な構成で得ることができる。図12は、 50倍の対物レンズを使用して、レーザー露光した銀塩 フィルムを拡大したものである。図12(a)は、図6 (b) で示した照明系で撮影した画像である。図12 (b) は、図9 (c) で示したように、点光源220' を光軸方向からずらして、斜光照明として影を強調し、 さらに輪郭をはっきりさせたものである。図12(a) と図12(b)とを比較すると、図12(b)では、さ らに細かい部分まではっきり見えていることが認められ る。なお、図11、図12は、いずれも平面においた被 検体を撮影している。しかし、例えば円筒状管面内部の ようなものであっても、その壁面に沿って顕微鏡本体を 移動させれば、同じように観察を進めることができる。

【発明の効果】以上のように、本発明による顕微鏡では、照明用光源をLEDのような点光源として極めて小

さい光学系を構成し、その光源からの光束で被検体を照 明するという単純な方法で、従来にない鮮明な画像が得 られる。それによってどのような被検体でも、どのよう な場所でも誰でもが容易に扱うことのできる顕微鏡装置 を提供することができ、さらに例えばLEDの持つ特 性、小型、堅牢、長寿命という特徴に加えて、消費電力 が少なく制御の応答性も高いという一般的な効果も顕微 鏡に付加することができる。また、光源の発するエネル ギーが熱に変化することは殆どないので、ファンなどに よる振動の発生がない装置として使用することができ る。これは光学系の倍率が高くなると、少しの振動が被 検体や光学系に微妙な影響を与え、画像に不鮮明さを与 えるということを防止することになる。LEDの光源自 体は小さなものであるから、ターレット状の構造にして 複数設置すれば、異なる波長の光源を用途に応じて使い 分けるようにすることもできる。そして、顕微鏡本体部 の小型化は、これまで観察がやっかいであった管面内側 のような狭いところでも観察ができるようになり、携帯 時にも便利となる。さらに、反射式光学系の採用で、被 検体を薄片に加工したり、反射ミラーによる集光などに 煩わされずにすむだけでなく、被検体を生きたままで観 察することができる。それによって小学校の低学年生の 様に特別な訓練のされていない者であっても容易に操作 することができる。

【0019】点光源としてのLEDの採用と、それを光 軸方向に移動させることや、斜め方向の光束の利用とい う方法の採用によって、被検体の観察面に微少な凹凸が あるような場合、影の発生によってその立体部陰影をよ り一層鮮明に表現できるから、比較的安価な構成の光学 顕微鏡でありながら、高級精密光学顕微鏡と同等品質の 観察画像を得ることができる。さらにCCD等により画 像信号を得て、それを表示部に表示することにより、同 時に複数の者が1つの画像を観察することができ、デー タとして保存すれば後日の再確認も支障無く行える。

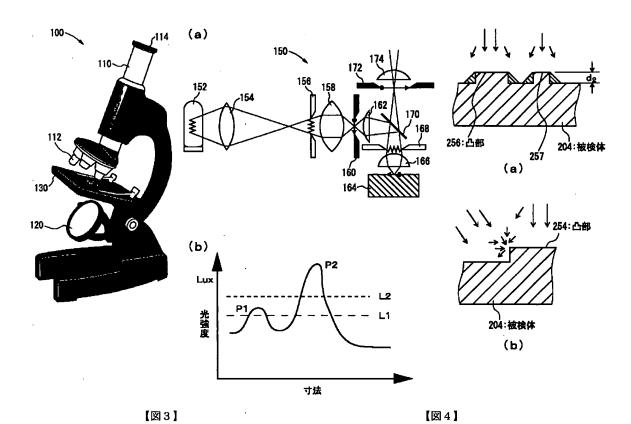
【図面の簡単な説明】

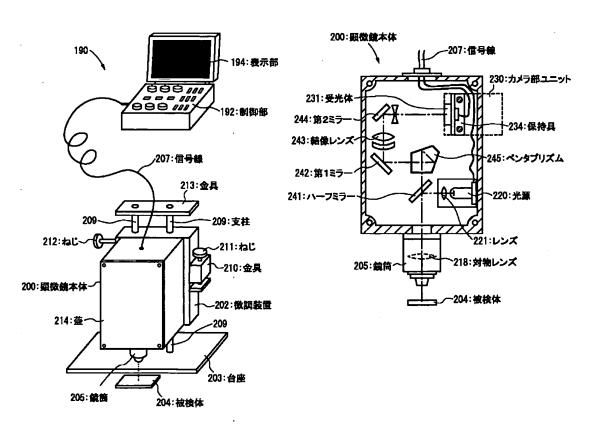
- 【図1】従来の光学顕微鏡の構成を示す図である。
- 【図2】反射型照明系の構成等を示す図である。
- 【図3】実施形態の顕微鏡装置の構成例を示す構成概略 図である。
- 【図4】顕微鏡本体内部の光学系を示した図である。。
- 【図5】被検体の照明状況を説明する図である。
- 【図6】光源の位置変化と被検体の照明関係を説明する 図である。

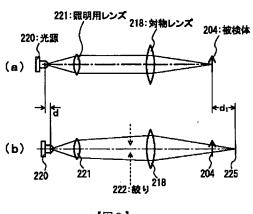
- 【図7】被検体の部分の拡大図である。
- 【図8】光源の他の構成例を示した図である。
- 【図9】被検体に対して斜め方向の照射を得る構成を示 す図である。
- 【図10】被検体に対して斜め方向の照射を得る他の構 成を示す図である。
- 【図11】実施形態の顕微鏡装置による画像を示す図で
- 【図12】光源の位置の変化による効果を示す図であ

【符号の説明】

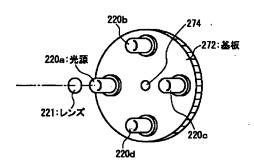
- 190 制御表示装置
- 192 制御部
- 194 表示部
- 200 顕微鏡本体
- 202 微調装置
- 203 台座
- 204 被検体
- 205 鏡筒
- 207 信号線
- 支柱 209
- 210 金具
- 211 ねじ
- 212 ねじ
- 213 金具
- 214 蓋
- 218 対物レンズ
- 220 光源
- 221 照明用レンズ (コンデンサ・レンズ)
- 241 ハーフミラー
- 242 第1ミラー
- 243 結像レンズ
- 245 ペンタプリズム
- 244 第2ミラー
- 230 カメラ部ユニット
- 231 受光体
- 234 保持具
- 272 基板
- 274 軸
- 296 ミラー
- 297 レンズ
- 298 プリズム
- 299 反射鏡



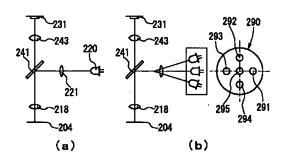


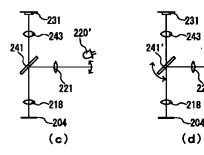


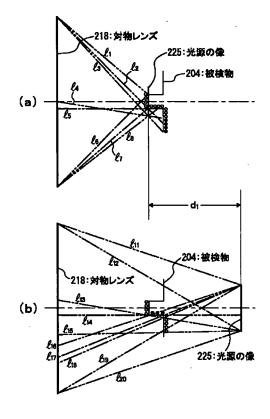
【図8】

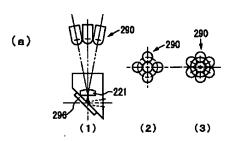


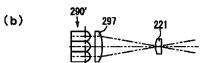
【図9】

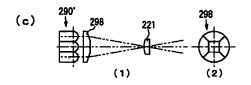


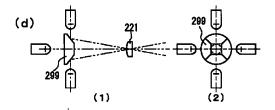


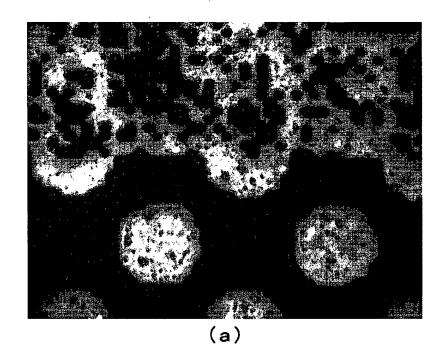


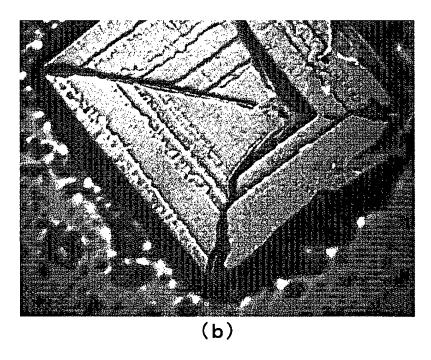






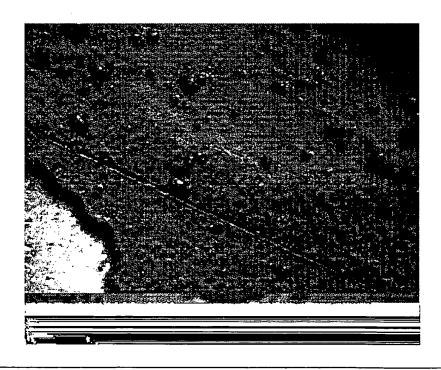








(a)



フロントページの続き

(72)発明者 小俣 公夫 埼玉県さいたま市太田窪一丁目1番21号 (72) 発明者 新田 勇 新潟県新潟市寺地1130-9 F ターム(参考) 2H052 AC04 AC09 AC14 AC27 AC33 AD02 AD32 AD33 AF14 AF21

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.